

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 5 部門第 2 区分
 【発行日】平成 18 年 3 月 2 日 (2006.3.2)

【公表番号】特表 2005-517875 (P2005-517875A)
 【公表日】平成 17 年 6 月 16 日 (2005.6.16)
 【年通号数】公開・登録公報 2005-023
 【出願番号】特願 2003-568738 (P2003-568738)
 【国際特許分類】

F 1 6 F 15/02 (2006.01)

【F I】

F 1 6 F 15/02 A

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 1 月 11 日 (2006.1.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

運動を制御された部品の振動を低減するための振動低減システムであって：

A) 前記運動を制御された部品を移動させるための、少なくとも一つの位置制御ドライブと；

B) 前記運動を制御された部品の位置を示すフィードバック位置信号を提供するための、少なくとも一つの位置センサと；

C) 前記少なくとも一つのセンサからのフィードバック信号を利用する前記少なくとも一つの位置制御ドライブを介して、前記運動を制御された部品の位置を制御するための、少なくとも一つの位置制御システムと；

D) 少なくとも一つの振動制御ドライブと；

E) 下記の (1) および (2) をプログラムされている、振動を制御するためのコンピュータプロセッサ；

(1) 前記フィードバック位置信号から振動信号を分離するための分離アルゴリズム；および

(2) 前記運動を制御された部品における振動を低減するように、前記振動制御ドライブに命令を与えるためのフィードバック制御アルゴリズム

とを具備するシステム。

【請求項 2】

請求項 1 に記載のシステムであって、前記運動を制御された部品にリソグラフィー機械の一部が含まれているシステム。

【請求項 3】

請求項 1 に記載のシステムであって、前記振動制御ドライブが電子的に活性なセラミックアクチュエータであるシステム。

【請求項 4】

請求項 1 に記載のシステムであって、前記位置制御ドライブが線型磁気アクチュエータであるシステム。

【請求項 5】

請求項 1 に記載のシステムであって、前記位置制御ドライブが音声コイルであるシステム。

【請求項 6】

請求項 1 に記載のシステムであって、前記位置制御ドライブが線型モータであるシステム。

【請求項 7】

請求項 1 に記載のシステムであって、前記少なくとも一つのセンサにレーザ干渉計位置決めシステムが含まれているシステム。

【請求項 8】

請求項 1 に記載のシステムであって、前記フィードバック制御アルゴリズムに線型二次レギュレータソリューションが含まれているシステム。

【請求項 9】

請求項 1 に記載のシステムであって、前記分離アルゴリズムに、線型二次レギュレータアプローチを利用する R L S 法および再構成法が含まれているシステム。

【請求項 10】

請求項 1 に記載のシステムであって、前記位置制御システムに、ランプにおいて前記運動を制御された部品を移動させるようにプログラムされたプロセッサが含まれているシステム。

【請求項 11】

請求項 1 に記載のシステムであって、少なくとも一つの位置センサに加速度計が含まれているシステム。